卒業論文

(題 目)

分子動力学法による 非晶・結晶PP/PEと グラファイト層界面のせん断強度評価

平成28年度

岐阜大学工学部 機械工学科 機械コース

氏名 村上 遥亮

目 次

1	緕	皆言 .		•••				•								•	•	•	•	•	•	•	1
2	角	解析手 氵	去								 •				•	•		•	•	•			2
	2.1	分子國	動力学	包法				•								•		•	•	•			2
	2.2	原子	間ポテ	ーンシ	ンヤ	ル										•		•	•	•			3
	2.3	高速(化手注	Ę.				•								•		•	•	•			12
3	<u>ې</u>	/ミュ	レーシ	/ =)	ン方	法					 •										•		14
4	シ	ノミュ	レーシ	/ =)	ン結	果ま	3よ	びま	≶察		 •	•			•	•		•		•	•		17
5	紿	吉.		•••				•								•		•	•	•			32
参	考文	献		•••												•		•	•	•			34
誃	辞.																						35

1 緒言

近年,単一材料よりも優れた性能を持つ複合材料の需要が高まっている.例えば, CFRP は金属材料と比べ比重,比強度に優れており,自動車や航空,宇宙など様々 な分野に応用されている.このような複合材料の破壊現象を評価する上で重要とな るのは,二材料間の界面強度である.

実験では炭素繊維をエポキシ樹脂に埋め込んだ試験片を用いた引張試験により, 界面強度が温度やひずみ速度に依存することを示している.^{(1),(2)} Wang らはマイク ロボンド試験により,単一炭素繊維とエポキシ樹脂の間の界面特性を評価している. ⁽³⁾ また,Zu らもマイクロボンド試験により,ガラス繊維-ポリプロピレン (PP) 樹脂 界面のせん断強度が PP の剛性に依存することを予想している.⁽⁴⁾ この他にも,プッ シュイン試験⁽⁵⁾⁻⁽⁷⁾ や繊維引抜き試験^{(8),(9)} 等によって繊維-樹脂間の界面特性が評価 されているが,界面といったそのものがナノメートル単位の現象を扱う際には,マ クロよりむしろミクロの視点からの知見が必要と考える.

ミクロな視点から知見を与えるものとして,分子動力学 (MD) シミュレーション がある. MD シミュレーションを用いて高分子を扱ったものとして,Frankland ら はカーボンナノチューブ (CNT) をポリエチレン (PE) 分子鎖中に埋め込んだシミュ レーションにより,その応力-ひずみ応答を評価している.⁽¹⁰⁾ 界面を評価したものと しては,Chowdhury らが PE 分子鎖中から CNT を引き抜くシミュレーションによ り,界面せん断強度がマトリックスの密度に依存することを示している.⁽¹¹⁾ また, Coto らもエポキシ樹脂から CNT を引き抜くシミュレーションにより,CNT の半径 の増加に従い界面せん断強度が減少することを示してる.⁽¹²⁾ 一方,複合材料中の高 分子/炭素繊維界面を想定したシミュレーションはなされていない.そこで本研究で は,グラファイト層間に非晶・結晶 PP/PE 分子鎖を充填し,圧着した後でせん断す る MD シミュレーションを行い,界面せん断強度を評価する.

2 解析手法

2.1 分子動力学法

分子動力学法 (molecular dynamics method,略して MD 法) は,系を構成する各 粒子についてニュートンの運動方程式

$$m_i \frac{d^2 \boldsymbol{r}_i}{dt^2} = \boldsymbol{F}_i \tag{2.1}$$

を立て、これを数値積分することにより粒子の軌跡を求める方法である.ここで、 m_i 、 r_i はそれぞれ粒子iの質量、位置ベクトルである.原子iに作用する力 F_i は、系の全ポテンシャルエネルギー E_{tot} の各位置における空間勾配として次式により求められる.

$$\boldsymbol{F}_{i} = -\frac{\partial E_{tot}}{\partial \boldsymbol{r}_{i}} \tag{2.2}$$

式 (2.2) の数値積分には, Verlet の方法,予測子-修正子法等がよく用いられる.本 研究では,以下に示す Verlet の方法を用いた.

時刻 $t + \Delta t$ と $t - \Delta t$ での粒子iの位置ベクトル $\mathbf{r}_i(t \pm \Delta t)$ をTaylor展開すると,

$$\boldsymbol{r}_{i}(t+\Delta t) = \boldsymbol{r}_{i}(t) + \Delta t \frac{d\boldsymbol{r}_{i}(t)}{dt} + \frac{(\Delta t)^{2}}{2} \frac{d^{2}\boldsymbol{r}_{i}(t)}{dt^{2}} + O\left((\Delta t)^{3}\right)$$
(2.3)

$$\boldsymbol{r}_{i}(t-\Delta t) = \boldsymbol{r}_{i}(t) - \Delta t \frac{d\boldsymbol{r}_{i}(t)}{dt} + \frac{(\Delta t)^{2}}{2} \frac{d^{2}\boldsymbol{r}_{i}(t)}{dt^{2}} - O\left((\Delta t)^{3}\right)$$
(2.4)

となる.ここで、 v_i を時刻tにおける原子iの速度とすると、

$$\frac{d\boldsymbol{r}_i}{dt} = \boldsymbol{v}_i\left(t\right) \tag{2.5}$$

であり、式 (2.1) と式 (2.5) を式 (2.3) と式 (2.4) に代入すると、

$$\boldsymbol{r}_{i}\left(t+\Delta t\right) = \boldsymbol{r}_{i}\left(t\right) + \Delta t \boldsymbol{v}_{i}\left(t\right) + \frac{\left(\Delta t\right)^{2}}{2} \frac{\boldsymbol{F}_{i}\left(t\right)}{m_{i}} + O\left(\left(\Delta t\right)^{3}\right)$$
(2.6)

$$\boldsymbol{r}_{i}\left(t-\Delta t\right) = \boldsymbol{r}_{i}\left(t\right) - \Delta t \boldsymbol{v}_{i}\left(t\right) + \frac{\left(\Delta t\right)^{2}}{2} \frac{\boldsymbol{F}_{i}\left(t\right)}{m_{i}} + O\left(\left(\Delta t\right)^{3}\right)$$
(2.7)

となる.両式の和と差をとると,

$$\boldsymbol{r}_{i}\left(t+\Delta t\right)+\boldsymbol{r}_{i}\left(t-\Delta t\right) = 2\boldsymbol{r}_{i}\left(t\right)+\left(\Delta t\right)^{2}\frac{\boldsymbol{F}_{i}\left(t\right)}{m_{i}}+O\left(\left(\Delta t\right)^{4}\right)$$
(2.8)

$$\boldsymbol{r}_{i}\left(t+\Delta t\right)-\boldsymbol{r}_{i}\left(t-\Delta t\right) = 2\Delta t\boldsymbol{v}_{i}\left(t\right)+O\left(\left(\Delta t\right)^{3}\right)$$
(2.9)

が得られる. Δt^3 以上の高次項は微小量のため無視できるとすると, 時刻 $t + \Delta t$ での位置ベクトルと t での速度は

$$\boldsymbol{r}_{i}\left(t+\Delta t\right) = 2\boldsymbol{r}_{i}\left(t\right) - \boldsymbol{r}_{i}\left(t-\Delta t\right) + \left(\Delta t\right)^{2}\frac{\boldsymbol{F}_{i}\left(t\right)}{m_{i}}$$

$$(2.10)$$

$$\boldsymbol{v}_{i}(t) = \frac{1}{2\Delta t} \left\{ \boldsymbol{r}_{i}(t + \Delta t) - \boldsymbol{r}_{i}(t - \Delta t) \right\}$$
(2.11)

と求められる. $t + \Delta t$ での座標を求めるには2つの時刻 $t \ge t - \Delta t$ での座標が必要 である. 第一ステップの計算(t = 0)では, $t = \Delta t$ での座標 $\mathbf{r}_i(\Delta t)$ は式(2.6)と初 速度から得ることができる. これより $\mathbf{r}_i(\Delta t) \ge \mathbf{r}_i(0)$ が既知となり,式(2.10)を繰 り返し適用することで各粒子の座標を求められる.

2.2 原子間ポテンシャル

式 (2.2) で示したように, 粒子に作用する力は系のポテンシャルエネルギーにより 決定される. 従って, 系のポテンシャルエネルギーをいかに精度よく評価するかが 分子シミュレーションにおいて重要となる. 本研究で扱うポリマー材料は強い共有 結合と弱い非共有結合からなり, また共有結合には分子鎖内部の結合角度や回転等 の内部自由度があるため, 系の全ポテンシャルエネルギー *E*_{tot} は次式のように表さ れる.

 \mathbf{PP}

$$E_{tot} = \Phi_{BS}(r) + \Phi_{BE}(\theta) + \Phi_{TO}(\phi) + \Phi_{VW}(\bar{r}) + \Phi_{INV}(\Theta)$$
(2.12)

 \mathbf{PE}

$$E_{tot} = \Phi_{BS}(r) + \Phi_{BE}(\theta) + \Phi_{TO}(\phi) + \Phi_{VW}(\bar{r})$$
(2.13)

右辺各項は、分子内の炭素間の結合長r,結合角 θ ,2面角 ϕ ,非共有原子間距離 \bar{r} , PPのCH周りの3つの二面角の和 Θ に対するポテンシャルを表す。本研究で解析対 象とする PP,PEに対しては、水素原子の運動は陽に扱わず、CH、CH₂,CH₃を単 一粒子として粗視化する united atom model により、以下の関数系およびパラメー タが提案されている.⁽¹³⁾

bond stretch potential (2体間ポテンシャル)

$$\Phi_{\rm BS}(r) = \sum k_r (r - r_0)^2 \tag{2.14}$$

bending potential (3体間ポテンシャル)

$$\Phi_{\rm BE}(\theta) = \sum k_{\theta}(\theta - \theta_0)^2 \tag{2.15}$$

torsion potential (4体間ポテンシャル)

$$\Phi_{\rm TO}(\phi) = \sum (V_1 \cos \phi + V_2 \cos 2\phi + V_3 \cos 3\phi)$$
(2.16)

van der Waals potential (2体間ポテンシャル)

$$\Phi_{\rm VW}(\bar{r}) = \sum \{A(\bar{r})^{-12} - C(\bar{r})^{-6}\}$$
(2.17)

inversion potential (面外角ポテンシャル)

$$\Phi_{\rm INV}(\Theta) = \sum K_2(\Theta - \Theta_0)^2 + K_8(\Theta - \Theta_0)^8 \quad (\Theta = \theta_1 + \theta_2 + \theta_3)$$
(2.18)

各関数のパラメータの値を表 2.1~2.5 に,ポテンシャル曲線を図 2.1~2.5 にそれぞ れ示した.

式 (2.2) による力の評価において,2体間相互作用の bond stretch および van der Waals は式 (2.19)~(2.20),3体間の bending は式 (2.21)~(2.23),4体間の torsion は 式 (2.24)~(2.27) のように導出される.式中の記号はそれぞれ図 2.6~2.8 に示した. ⊖bond stretch ポテンシャル

$$\Phi_{\rm BS}(r) = \sum k_r (r - r_0)^2$$

Table 2.1Potential parameter for bond stretch.

	r_0	k_r
	[nm]	$[kJ/(mol \cdot nm^2)]$
$CH_2 - CH$	0.1504	1.306×10^5
$CH_2 - CH_2$	0.1533	$1.373 imes 10^5$
$CH_3 - CH$	0.1535	1.481×10^5



Fig. 2.1 Relationship between bond stretch potential $\Phi_{\rm BS}$ and bond length r.

⊖bending ポテンシャル

$$\Phi_{\rm BE}(\theta) = \sum k_{\theta} (\theta - \theta_0)^2$$

	θ_0	$k_{ heta}$
	[deg]	$[kJ/(mol \cdot rad^2)]$
C - CH - C	111.0	334.7
$C - CH_2 - C$	113.3	374.7

Table 2.2 Potential parameter for bending.



Fig. 2.2 Relationship between bending potential Φ_{BE} and bending angle θ .

⊖torsion ポテンシャル

 $\Phi_{\rm TO}(\phi) = \sum (V_1 \cos\phi + V_2 \cos 2\phi + V_3 \cos 3\phi)$

	V_1	V_2	V_3	V_6
	[kJ/mol]	[kJ/mol]	[kJ/mol]	[kJ/mol]
$C - CH_2 - CH - C$	4.686	2.428	4.435	0.0
$C - CH_2 - CH_2 - C$	3.935	2.177	7.786	0.0

Table 2.3Potential parameter for torsion.



Fig. 2.3 Relationship between torsion potential $\Phi_{\rm TO}$ and torsion angle ϕ .

 \bigcirc van der Waals ポテンシャル

$$\Phi_{\rm VW}(\bar{r}) = \sum (A\bar{r}^{-12} - C\bar{r}^{-6})$$

Table 2.4Potential parameter for van der Waals.

	A	V
	$[kJ/(mol \cdot nm^{12})]$	$[kJ/(mol \cdot nm^6)]$
CH - CH	2.971×10^{19}	3.318×10^9
$CH_2 - CH_2$	2.971×10^{19}	6.904×10^9
$\mathrm{CH}_3-\mathrm{CH}_3$	2.971×10^{19}	10.042×10^9



Fig. 2.4 Relationship between van der Waals potential Φ_{VW} and internuclear separation \bar{r} .

⊖inversion ポテンシャル

$$\Phi_{\rm INV}(\Theta) = \sum K_2(\Theta - \Theta_0)^2 + K_8(\Theta - \Theta_0)^8 \qquad (\Theta = \theta_1 + \theta_2 + \theta_3)$$

	K_2	K_8
	$[\rm kJ/(\rm mol\cdot rad^{-2})]$	$[kJ/(mol \cdot rad^{-8})]$
CH	144.3	1.757×10^{5}

Table 2.5Potential parameter for inversion.



Fig. 2.5 Relationship between inversion potential Φ_{INV} and inversion angle Θ .

$$\boldsymbol{F}^{\eta} = -\boldsymbol{F}^{\beta} + \frac{\boldsymbol{r}^{\alpha\gamma} \cdot \boldsymbol{r}^{\gamma\eta}}{|\boldsymbol{r}^{\gamma\eta}|^2} \boldsymbol{F}^{\alpha} + \frac{\boldsymbol{r}^{\beta\eta} \cdot \boldsymbol{r}^{\gamma\eta}}{|\boldsymbol{r}^{\gamma\eta}|^2} \boldsymbol{F}^{\beta}$$
(2.27)

$$\boldsymbol{F}^{\gamma} = -\boldsymbol{F}^{\alpha} - \frac{\boldsymbol{r}^{\alpha\gamma} \cdot \boldsymbol{r}^{\gamma\eta}}{|\boldsymbol{r}^{\gamma\eta}|^2} \boldsymbol{F}^{\alpha} - \frac{\boldsymbol{r}^{\beta\eta} \cdot \boldsymbol{r}^{\gamma\eta}}{|\boldsymbol{r}^{\gamma\eta}|^2} \boldsymbol{F}^{\beta}$$
(2.26)

$$\boldsymbol{F}^{\beta} = \frac{\Phi'(\phi)}{\sin\phi} \frac{1}{|\boldsymbol{A}^{\alpha}||\boldsymbol{A}^{\beta}|} \{ \boldsymbol{A}^{\alpha} - \frac{\boldsymbol{A}^{\alpha} \cdot \boldsymbol{A}^{\beta}}{|\boldsymbol{A}^{\beta}|^{2}} \boldsymbol{A}^{\beta} \}$$
(2.25)

$$\cos \phi = \frac{\mathbf{A} \cdot \mathbf{A}}{|\mathbf{A}^{\alpha}||\mathbf{A}^{\beta}|}$$
$$\mathbf{F}^{\alpha} = \frac{\Phi'(\phi)}{\sin \phi} \frac{1}{|\mathbf{A}^{\alpha}||\mathbf{A}^{\beta}|} \{\mathbf{A}^{\beta} - \frac{\mathbf{A}^{\alpha} \cdot \mathbf{A}^{\beta}}{|\mathbf{A}^{\alpha}|^{2}} \mathbf{A}^{\alpha}\}$$
(2.24)

$$egin{array}{rcl} oldsymbol{A}^lpha &=& oldsymbol{r}^{lpha\gamma} - rac{oldsymbol{r}^{lpha\gamma\gamma} \cdot oldsymbol{r}^{\gamma\eta}}{|oldsymbol{r}^{\gamma\eta}|^2}oldsymbol{r}^{\gamma\eta} \ oldsymbol{A}^eta &=& oldsymbol{r}^{eta\gamma} - rac{oldsymbol{r}^{eta\eta} \cdot oldsymbol{r}^{\gamma\eta}}{|oldsymbol{r}^{\gamma\eta}|^2}oldsymbol{r}^{\gamma\eta} \ oldsymbol{cos} \phi &=& oldsymbol{A}^lpha \cdot oldsymbol{A}^eta \ oldsymbol{cos} + oldsymbol{A}^lpha \cdot oldsymbol{A}^eta \ oldsymbol{r}^{\gamma\eta} = oldsymbol{r}^{eta\gamma} + oldsymbol{A}^eta \cdot oldsymbol{r}^eta \ oldsymbol{r}^{\gamma\eta} = oldsymbol{r}^{eta\gamma} + oldsymbol{r}^eta \cdot oldsymbol{r}^eta \ oldsymbol{r}^{eta\gamma} = oldsymbol{r}^{eta\gamma} + oldsymbol{r}^oldsymbol{r}^{eta\gamma} + oldsymbol{r}^{eta\gamma} + oldsymbol{r$$

4体間相互作用

$$\boldsymbol{F}^{\gamma} = -\boldsymbol{F}^{\alpha} - \boldsymbol{F}^{\beta} \tag{2.23}$$

$$\boldsymbol{F}^{\beta} = \frac{\Phi'(\theta)}{\sin\theta} \frac{1}{|\boldsymbol{r}^{\alpha\gamma}| |\boldsymbol{r}^{\beta\gamma}|} \{ \boldsymbol{r}^{\alpha\gamma} - \frac{\boldsymbol{r}^{\alpha\gamma} \cdot \boldsymbol{r}^{\beta\gamma}}{|\boldsymbol{r}^{\beta\gamma}|^2} \boldsymbol{r}^{\beta\gamma} \}$$
(2.22)

$$\cos\theta = \frac{\boldsymbol{r}^{\alpha\gamma} \cdot \boldsymbol{r}^{\beta\gamma}}{|\boldsymbol{r}^{\alpha\gamma}||\boldsymbol{r}^{\beta\gamma}|}$$
$$\boldsymbol{F}^{\alpha} = \frac{\Phi'(\theta)}{\sin\theta} \frac{1}{|\boldsymbol{r}^{\alpha\gamma}||\boldsymbol{r}^{\beta\gamma}|} \{\boldsymbol{r}^{\beta\gamma} - \frac{\boldsymbol{r}^{\alpha\gamma} \cdot \boldsymbol{r}^{\beta\gamma}}{|\boldsymbol{r}^{\alpha\gamma}|^2} \boldsymbol{r}^{\alpha\gamma}\}$$
(2.21)

3体間相互作用

$$\boldsymbol{F}^{\beta} = -\boldsymbol{F}^{\alpha} \tag{2.20}$$

$$r = |\mathbf{r}^{\alpha\beta}|$$
$$\mathbf{F}^{\alpha} = -\frac{\Phi'(r)}{r}\mathbf{r}^{\alpha\beta}$$
(2.19)

2体間相互作用



Fig. 2.6 Two molecules i, j and intermolecule vector \boldsymbol{r}_{ij} .



Fig. 2.7 Three molecules i, j, k and bendig angle θ .



Fig. 2.8 Four molecules i, j, k, l and torsion angle ϕ .

2.3 高速化手法

粒子数 N の系において粒子間の全相互作用を評価すると、1step に $N \times (N-1)$ 回の計算が必要となるため、N が大きくなると極めて膨大な計算量となる.実際に は、一定距離以上離れた粒子は影響を及ぼさないので、作用を及ぼす範囲 (カット オフ半径 r_c)内の粒子からの寄与を効率よく計算することによって高速化できる.従 来よく用いられてきた高速化手法に粒子登録法がある.これは、図に示したように、 r_c より一回り大きい半径 r_{fc} 内の粒子をメモリーに記憶し、その中で r_c 内の相互作 用を評価する方法であり、N × (r_c 内粒子数 \ll N - 1)に計算負荷が減少される.し かし、粒子登録法では r_{fc} 半径より外の粒子が r_c 内に達すると力の評価が適切でな くなるので、一定のステップごとに登録粒子の更新 (N × (N - 1)回の探査)を行わ なければならない.このため、系がある程度の規模以上になると、粒子登録による 高速化は登録更新の計算負荷により打ち消される.



Fig. 2.9 Schematic of bookkeeping method.

別の高速化手法としてブロック分割法がある.図(a)に示すように、シミュレート する系をカットオフ距離程度の格子状に分割し、各ブロックに属する粒子をメモリー に記憶する.着目している粒子に作用する力を評価する際には、その粒子が属する ブロックおよび隣接するブロックから相互作用する粒子を探索して行う(図(b)).粒 子が属するブロックは、粒子の位置座標をブロックの辺長*bx、by*で除した際の整数 により判断できるので、ブロック登録時の計算負荷は粒子数*N*のオーダーとなる. 従って、粒子登録法では登録更新の負荷が大きくなるような大規模な系でも高速化 が可能である.

ポリマーのポテンシャルでは,共有結合部の bond stretch, bending, torsion, inversion ポテンシャルは相互作用する粒子が同一分子鎖内位であらかじめ決まってい るため,原子対を探索する必要はなく分子鎖単位での並列化による高速化も容易で ある.一方, van der Waals ポテンシャルは異分子鎖間,あるいは,同一分子鎖内の 4 粒子以上離れた全粒子に対して相互作用を評価する必要があり,本研究で扱うよ うな大規模な系では,ブロック分割による高速化が必要となる.



Fig. 2.10 Schematic of domain decomposition method.

3 シミュレーション方法

x, y方向は周期境界, z方向は仮想壁面とした立方体セル中に PP/PE 分子鎖をそ れぞれランダムに成長させた非晶 PP/PE 無限薄板,ならびに,図3.1の単位格子を並 べた結晶 PP に,剛体グラファイト壁を配置して圧着・せん断シミュレーションを行う (図3.2参照).表3.1に各シミュレーションモデルモデルの分子鎖数と分子鎖1本当た りの粒子数を示す.いずれも293K で構造緩和したときの寸法は15nm×15nm×15nm に制御した.

まず、1step あたりに 3.0×10^{-5} nm の割合でグラファイト壁を壁の厚さ h_{wall} 分接 近 (上の壁を $-h_{wall}/2$,下の壁を $h_{wall}/2$ 移動) させ、分子鎖とグラファイト壁を圧 着させた. グラファイト壁は (1) 表面凹凸なし、(2)x 方向に正弦波で凹凸をつけたも の (1D パターン)、(3)x、y 方向に正弦波で凹凸をつけたもの (2D パターン) につい て検討した.凹凸周期は 2π 、 4π 、 6π とした.図 3.2 に分子鎖の初期配置とグラファ イト壁の凹凸の例を、図 3.3 および図 3.4 に 1D パターン、2D パターンの例を示す. 圧着後、上のグラファイト壁を圧着過程と同じ速度でx方向に移動させ、せん断シ ミュレーションを行った.

			Number of	Number of UA
Model			chains	in 1 chain
aPP100	Amorphous	PP	329	$100C_3H_6$
aPP32		PP	1000	$32C_3H_6$
aPP12		\mathbf{PP}	2500	$12C_3H_6$
aPE500		\mathbf{PE}	200	$500 \mathrm{CH}_2$
aPE200		PE	500	$200 \mathrm{CH}_2$
cPP70	Crystal	PP	33	$70C_3H_6$

Table 3.1Simulation model's conditions.



Fig. 3.1 Unit lattice of 3_1 helix iPP.



Fig. 3.2 Simulation models.



Fig. 3.3 Graphite wall pattern (1D).



Fig. 3.4 Graphite wall pattern (2D).

4 シミュレーション結果および考察

図4.1~図4.3に1Dパターンでのグラファイト壁に生じた*x*方向の力の時間変化 を示す.図の上部には圧着過程からせん断過程に移行した直後に生じた反力をせん 断強度として評価した点のスナップショットを示している.図4.4にグラファイト壁 の凹凸によるせん断強度の違いをまとめて示した.まず,非晶 PP/PE,結晶 PPの 違いによるせん断強度の変化を見るため,aPP100,aPE200,cPP70のせん断強度 を比較する.今回検証したどのシミュレーションモデルも,非晶 PP/PE は表面凹凸 がない系はせん断に対する抵抗はほぼ0で,凹凸の周期が小さくなるに従ってせん 断強度が上昇している.本モデルでは凹凸の高さを同じとしているので,せん断方 向の壁の勾配にせん断抵抗が依存するというごく自然な結果となる.また,高分子 の種類に着目してせん断強度を比較した場合,グラファイト壁の凹凸周期に関わら ず非晶 PE が最も低く,非晶 PP,結晶 PP の順に高くなるという結果が得られた.

図4.5~図4.7に2Dパターンでのグラファイト壁に生じた*x*方向の力の時間変化 を,図4.8に1Dパターンと比較したせん断強度の違いを示す.2Dパターンでも,表 面凹凸が小さい方がせん断強度が上昇する傾向は変わらない.1Dパターンと比較 すると,どのシミュレーションモデルにおいてもせん断強度は壁面の凹凸周期にか かわらず2Dパターンが1Dパターンを下回っている.これは壁面の*y*軸方向にも凹 凸をつけたことによりせん断方向の壁面の面積が小さくなったことによるものと考 える.

図 4.9~図 4.11 に非晶モデルで分子鎖長さを変更した場合のグラファイト壁に生 じた x 方向の力の時間変化を,図 4.12 に分子鎖長さの違いによるせん断強度の違い を示す.グラファイト壁が flat の場合,非晶 PP/PE はすべてせん断に対する抵抗は ほぼ 0 である.凹凸をつけた場合,PP,PE 共に分子鎖長さが短い方がせん断強度 が高くなる傾向が認められた.このことから,壁面から離れたバルク部分での絡み 合いはせん断強度に寄与しないことがわかる.一方,凹凸がある系で分子鎖長さが

17

短い方が高いせん断強度を示したのは,圧着時の凹部への入り込みやすさが考えら れる.これについて考察するため,上のグラファイト壁の最下層(表面の凸部位置) より上にある粒子数を壁面凹部に充填された粒子数として,圧着後の構造について 分子鎖長さによる粒子数の違いを評価した.図4.13に凹部に充填された粒子数と表 面凹凸の関係を示す.PP,PEいずれも分子鎖長さの短い方が凹部に充填された粒 子数が多いことがわかる.壁面凹部に充填される粒子量が多いほど分子間の距離が 縮まり,van der Waals 力が増加するため,せん断方向の抵抗力が高くなると考え る.しかし,分子鎖の入り込みやすさ以外にも壁面の勾配に沿った形状変化のしや すさなどが考えられるため,より詳細な検討が必要と考える.



Fig. 4.1 Change in the shear force on the GF wall (amorphous PP model, $100C_3H_6x329$, flat & 1D patten surface).



Fig. 4.2 Change in the shear force on the GF wall (amorphous PE model, $500CH_2x200$, flat & 1D patten surface).



Fig. 4.3 Change in the shear force on the GF wall (crystal PP model, $70C_3H_6x33$, flat & 1D patten surface).



Fig. 4.4 Change in the maximum shear force.



Fig. 4.5 Change in the shear force on the GF wall (amorphous PP model, $100C_3H_6x329$, 2D patten surface).



Fig. 4.6 Change in the shear force on the GF wall (amorphous PE model, $500CH_2x200$, 2D patten surface).



Fig. 4.7 Change in the shear force on the GF wall (clystal PP model, $70C_3H_6x33$, 2D patten surface).





Fig. 4.8 Change in the maximum shear force (2D pattern).



Fig. 4.9 Change in the shear force on the GF wall (amorphous PP model, $32C_3H_6x1000$, flat & 1D patten surface).



Fig. 4.10 Change in the shear force on the GF wall (amorphous PP model, $12C_3H_6x2500$, flat & 1D patten surface).



Fig. 4.11 Change in the shear force on the GF wall (amorphous PE model, $200CH_2x500$, flat & 1D patten surface).



Fig. 4.12 Change in the maximum shear force.



Fig. 4.13 Number of particles filled in the surface pit.

5 結言

繊維-樹脂界面のせん断強度についてミクロな視点からの知見を得るために、グラ ファイト壁間に非晶 PP/PE,結晶 PP 分子鎖を充填し、圧着した後でx方向に移動 させる MD シミュレーションを行った.グラファイト壁は (1)flat,(2)x方向に 2π , 4π , 6π の正弦波で表面凹凸をつけたもの (1D パターン),(3) 同様の凹凸周期でx, y方向に表面凹凸をつけたもの (2D パターン) について検討した.得られた結果を以 下に示す.

- 1. 1Dパターンでグラファイト壁に生じるせん断強度を調べたところ、どのシミュレーションモデルでも flat が最も小さく、凹凸周期が小さくなるにしたがって上昇する傾向が見られた.
- 2. 分子鎖の種類別にせん断強度を比較した場合,凹凸周期にかかわらず非晶 PE モデルが最も小さく,非晶 PP,結晶 PP の順に高くなる傾向が見られた.
- 3. 2D パターンも凹凸周期が小さい方がせん断強度が上昇する傾向が見られた. また,1D パターンとせん断強度を比較した場合,凹凸周期にかかわらず2D パターンの方が低い値を示した.
- 4. 分子鎖長さの違いによるせん断強度の変化を比較した結果, PP, PE モデル共 に分子鎖長さの短い方がせん断強度は上昇する傾向が見られた.

- 5.1および3より, せん断強度はせん断方向での壁の勾配, ならびに面積により 決定付けられるという自然な結論が導かれた.
- 6. 4で分子鎖長さの短い方がせん断強度が上昇した要因として、凹部への入り込みやすさが考えられるため、圧着時に凹部に充填された粒子数を調べた.その結果、分子鎖長さの短い方が多く充填される傾向が認められた.このため、van der Waals力による反力が増加し、短い分子鎖ほどせん断抵抗が増加したと考える.

参考文献

- (1) J. Koyanagi, et al, Com. Str., 92, (2010), 150-154
- (2) 三輪・大沢・足立, 繊維学会誌, 41, (1985), T223-T230
- (3) C. Wang, et al, Mat. and. Des., 85, (2015), 800-807
- (4) M. Zu, et al, *Carbon*, **50**, (2012), 1271-1279
- (5) M. Rodriguez, et al, Com. Sci. and. Tec., 72, (2012), 1924-1932
- (6) A. S. Childers, et al, Mat. Let., 174, (2016), 106-109
- (7) D. Esqu-de los Ojos, et al, Com. Mat. Sci., 117, (2016), 330-337
- (8) 小柳・河合・萩原・渡辺,実験力学,10,4,(2010),407-412
- (9) J. Koyanagi, et al, Com. PartA, 43, (2012), 1819-1827
- (10) S. J. V. Frankland, et al, Com. Sci. and. Tec., 63, (2003), 1655-1661
- (11) S. C. Chowdhury and T. Okabe, Com. PartA, 38, (2007), 747-754
- (12) B. Coto, et al, Com. Mat. Sci., 79, (2013), 99-104
- (13) 桑島・野間・逢坂, 第四回計算化学シンポジウム, (1994), 53

謝辞

本論文を作成するにあたり,懇切丁寧に指導していただいた屋代如月教授と内藤 圭史助教に心より感謝の意を表します.また,本研究において計算機は科学研究費 助成事業により援助していただきました.ここに感謝いたします.そして,同輩と してともに切磋琢磨し合った足立善英氏,片岡裕司氏,坪井伶以氏,二村晟平氏,山 内雅也氏,山下真司氏,山脇一輝氏,先輩として数多くの助言をしてくださった寺田 稜氏,西川涼一郎氏に感謝したします.最後に,4年間の学生生活を暖かく見守り, 経済面や精神面で支えて頂いた家族に感謝いたします.ありがとうございました.